国立大学法人電気通信大学 研究設備センター

先端研究設備部門

研究設備センター 先端研究設備部門では、電子・光デバイス、ナノテクノロジー、ロボットなどに関する「モノづくり」を行うために、クリーンルームをはじめとする施設や、最先端の材料作成、加工、性能評価を行う設備や装置を有しています。

当部門は、これらの豊富な施設・設備を有効に活用し、「モノづくり」をサポートしています。

第21回 産学官連携DAY
研究設備センター 見学ツアー
先端研究設備部門@東8号館

《第 1 部》12:30～13:45　《第 2 部》14:30～15:45

クリーンルーム内部やデバイス作製装置などをご紹介します。

Class10000クリーンルーム

スパッタリング装置　RTA　オゾンアッシャー　RIE（Cl/F）
電子ビーム蒸着装置　酸化･拡散炉　他

Class100イエロールーム

デジタル顕微鏡　微分干渉顕微鏡　表面粗さ計
マスクアライナー　スピンナー　EBL　他

電子･光材料 成膜･分析･評価設備

MOCVD装置　FE-SEM　W-SEM　X線回折装置　AFM
3D光干渉観測システム　他

生体情報センサー融合実験室

クリーンベンチ　グロースキャビネット恒温振盪培養器　HPLC
低温室　オートクレーブ　インキュベーター　遠心分離機　他

装置のご利用希望、
お問合せは
こちらからどうぞ

《お問合せフォーム》

HPで先端部門の
装置をご紹介して
います

《先端部門HP》

https://www.darf.cia.uec.ac.jp/wp/